

令和元年 11 月吉日

お客様各位

伯東株式会社
システムプロダクツカンパニー
営業三部

LA-LIBS セミナー / 表面解析セミナー 2019 開催のご案内

拝啓 皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび米国 Applied Spectra Inc. (以下 ASI)は豪州 Australian Scientific Instruments より短波長でのレーザー照射が可能かつ地球化学試料の分析に特化したサンプルチャンバーを備えるエキシマレーザーアブレーションシステム“RESolution”および熟年代測定装置“Alphachron”、“RESOchron”のプロダクトラインを継承いたしました。これにより ASI 社は独自技術である高精度 LIBS 分析、およびレーザーアブレーション—LIBS 同時分析という特徴に加え、一般的に使用される固体試料元素分析用レーザーアブレーションシステムについて“ナノ秒 Nd-YAG”、“ナノ秒 excimer”、“Yb-ダイオード型フェムト秒レーザー”の全てをプロダクトラインに揃えたこととなります。

これを受け ASI 社の国内総代理店である弊社伯東株式会社も本装置デモ機の運用に関して慶應義塾大学様との産学連携協定を締結し、今後ますますの国内デモ測定や共同研究体制の拡充を目指して参ります。

これらの新規取り扱い装置、国内デモ分析室のご利用に関するご紹介、また最新の LA-LIBS アプリケーションご紹介のため、以下の内容にてセミナーを開催することとなりました。

また、本セミナーでは弊社が新規に取り扱いを開始した SEM や顕微鏡画像の高度画像解析ソフトウェアも併せてご案内させて頂き、元素分析に留まらず広く表面分析、解析の最新情報を皆様にお届けできればと存じます。

是非皆様に御参加頂きたく、ここにご案内申し上げます。

敬具

記

開 催 日 :

令和元年 12 月 10 日(火)、11 日(水) — 慶應義塾大学 (神奈川会場)

令和元年 12 月 16 日(月) — 大阪大学 (大阪会場)

時 間 : 別紙プログラムをご参照ください。

場 所 :

12 月 10 日、11 日— 慶應義塾大学 理工学部(矢上キャンパス) 産学連携棟(36 棟) 2 階 セミナールーム
(神奈川県横浜市港北区日吉 3 丁目 14-1、東急日吉駅より徒歩 13 分)

12 月 16 日— 大阪大学 レーザー科学研究所 I 棟 4 階 大ホール
(大阪府吹田市山田丘 2-6、大阪モノレール 阪大病院前駅より徒歩 13 分)

参加募集人数 : 各会場約 30 人程度

参加申込締切 : 定員に達し次第終了

申 込 先 :

参加ご希望の方は、御氏名・御所属・参加希望の会場(神奈川 or 大阪)をご記入のうえ下記まで電子メールまたは FAX でお申し込みください(本書末尾参加申し込みテンプレートをご利用ください)

電子メール : info@g5-hakuto.jp

LA-LIBS セミナー / 表面解析セミナー2019 プログラム

講師：朱 彦北先生(AIST)

Mr. Chuck Sisson (ASI)

Ms. Camille Evans (ASI)

森田 泰司 (日本ローパー)

池崎 満里子 (伯東)

中江 俊喜 (伯東)

神奈川会場

12月10日(火)

9:30-10:00	受付
10:00-10:15	ご挨拶
10:15-11:45	レーザーアブレーションおよび LIBS の技術紹介 (ASI)
11:45-13:00	昼食
13:00-14:00	LA/LIBS を他種分析技術と比較する(ASI)
14:00-15:30	招待講演： LIBS と LA-ICP-MS を用いた定性分析と定量分析の試み (産業技術総合研究所 朱 彦北先生)
15:30-15:50	休息
15:50-16:50	ASI 新製品 “Resolution” のご紹介 (ASI)
16:50-17:50	Artificial Intelligence(AI) 搭載画像解析技術のご紹介(伯東)

*英語での発表は日本語スライドにより行われます。また、ご要望の数が多い場合簡易通訳を行います。御参加お申し込みの際に併せてご希望をお寄せ頂ければ幸いです。

12月11日(水)

9:30-10:00	受付
10:00-11:00	LA/LIBS データ解析ソフトウェアについて (ASI)
11:00-11:45	LA/LIBS 装置の選択(レーザーの種類、検出器、オプション等)
11:45-01:00	昼食
13:00-14:00	LA-LIBS のアプリケーションについて(ASI)
14:00-15:00	画像解析ソフトウェア “Image Pro” の実演デモ
15:00-18:00	LA-LIBS 装置デモ、質疑応答

*英語での発表は日本語スライドにより行われます。また、ご要望の数が多い場合簡易通訳を行います。御参加お申し込みの際に併せてご希望をお寄せ頂ければ幸いです。

大阪会場

10:00-10:15	受付
10:15-12:15	レーザーアブレーションおよび LIBS の技術紹介 (ASI)
12:15-13:15	昼食
13:15-15:15	LA-LIBS データ解析ソフトウェアとアプリケーションご紹介(ASI)
15:15-15:30	休憩
15:30-16:30	Artificial Intelligence(AI) 搭載画像解析技術のご紹介(伯東)
16:30-16:45	慶應義塾大学 LIBS 測定室開設のご案内(伯東)
16:45-17:15	質疑応答

*英語での発表は日本語スライドにより行われます。また、ご要望の数が多い場合簡易通訳を行います。御参加お申し込みの際に併せてご希望をお寄せ頂ければ幸いです。

- 質疑応答の時間には事前に頂いたレーザーアブレーション、LIBS や表面分析、画像解析についての御質問やご要望にお答えする機会を設けさせていただきます。御参加お申し込みの際に併せてご記入頂ければ幸いです。

LA-LIBS セミナー / 表面解析セミナー2019 参加申し込み

お名前：

ご所属：

ご連絡先(電話)：

ご連絡先(メール)：

御参加希望の会場(ご希望の会場を○で囲んでください)

神奈川会場(12月10-11日)

大阪会場(12月16日)

[慶應義塾大学矢上キャンパス]

[大阪大学レーザー科学研究所]

*希望調査 英語の発表(日本語スライド)に対し簡易通訳を

希望する

希望しない

どちらでもよい

その他(レーザーアブレーション、LIBS や表面分析、画像解析についての御質問やご要望等ございましたらご記入ください)

送り先： 伯東 LA-LIBS セミナー / 表面解析セミナー2019 係

mail(pdf): info@g5-hakuto.jp

FAX: 03-3225-9011

担当：中江